

1. 개정이유 및 주요내용

기업의 연구개발 촉진 및 투자 활성화를 위해 「관세법」 제90조제1항 제4호 및 같은 법 시행규칙 제37조제4항제1호에 따라 관세를 감면할 수 있는 산업기술 연구·개발용 물품에 금속 절삭가공용 선반, 액압식 프레스, 복합진동 초음파용접기 등을 추가하고, 종전의 감면 대상이었던 고속기류 건조기, 복합사이클 부식시험기, 열충격시험기 등은 제외하여 총 35개 품목에 대해 관세를 감면하려는 것임.

2. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 과학기술정보통신부 등과 합의되었음
- 라. 기 타 :

기획재정부령 제 호

관세법 시행규칙 일부개정령안

관세법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.
별표 1의2를 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(관세가 감면되는 산업기술 연구·개발용 물품에 관한 경과조치)
이 규칙 시행 전에 수입신고한 물품에 대해서는 별표 1의2의 개정규정에
에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

■ 관세법 시행규칙 [별표 1의2] <개정 2024. 7. 30.>

법 제90조제1항제4호에 따라 관세가 감면되는 산업기술 연구·개발용 물품
(제37조제4항제1호 관련)

연번	관세율표 번호		품명	규격
	호	소호		
1	8419	89	기타	냉각기(cooling plant and machinery)로서 양자컴퓨터용 소자를 영하 273도(℃) 이하로 냉각·냉동 또는 액화할 수 있는 것으로 한정한다.
2	8419	89	기타	항온항습기(항온기, 항습기 및 항습배양기를 포함한다)로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 온도의 허용 오차 범위가 ±3.0도(℃) 이하이거나 습도의 허용 오차 범위가 ±5퍼센트(%) 이하인 것 2. 사용 온도가 영상 100도(℃) 이상이거나 영하 40도(℃) 이하인 것 3. 온도, 습도, 시간, 조명도(照明度) 또는 사이클(cycle)을 조정할 수 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 열 스트레스(stress)를 가함으로써 시료의 열 내구성을 측정할 수 있는 것 나. 계측기와 연결하여 주파수를 측정할 수 있는 것
3	8420	10	캘린더기(calendering machine)나 그 밖의 로울기(rolling machine)	진공 라미네이터(vacuum laminator)로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 가압 상태에서는 1.0메가파스칼(Mpa) 이하, 진공 상태에서는 15초당 40헥토파스칼(Hpa) 이하로 상부와 하부에서 균등하게 압력을 가할 수 있는 것 2. 동시에 진공, 가압, 가열하여 패키지 기판을 성형할 수 있는 것
	8422	40	그 밖의 포장기계(열수축 포장기계를 포함한다)	
	8479	89	기타	
4	8424	89	기타	현상·박리기(developer stripper machine)로서 한 개의 설비 내에서 현상과 박리 기능의 구현이 가능한 것으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 설비 내 컨베이어 방식으로 기판이 이송되고, 설비 내에서 약품이 분사되어 공정이 진행되는 것

				2. 현상기는 인쇄회로기판(PCB) 위 감광성 레지스트의 비노광 부분을 현상액을 이용하여 제거할 수 있는 것 3. 박리기는 인쇄회로기판(PCB) 위 경화된 감광성 레지스트를 박리액을 이용해 제거할 수 있는 것
5	8456	11	레이저 방식으로 하는 것	레이저발전기로서 레이저의 파장이 1,340나노미터(nm) 이하인 것으로 한정한다.
6	8456	90	기타	이온밀링기/이온밀링장치(ion milling system)로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 이온빔(ion beam) 또는 전자빔(electron beam)을 이용하여 반도체웨이퍼 또는 시편(試片)을 가공할 수 있는 것 2. 가속전압이 40킬로볼트(kV) 이하인 아르곤(Ar) 또는 갈륨(Ga) 이온 총(ion gun)을 장착한 것
7	8457	10	머시닝센터(machining centre)	머시닝센터로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 머시닝, 선삭(旋削) 및 연삭(研削) 기능을 모두 융합한 복합가공기능이 있는 것 2. 수치 제어 방식으로 동시에 3축 이상을 제어할 수 있는 것 3. 원 칙킹(one chucking)으로 다면·곡면 가공이 가능한 것
8	8458	11	수치제어식	금속 절삭가공용의 선반(lathe)으로(터닝센터(turning centre)를 포함) 금속을 절삭하는 방법으로 금속의 표면을 가공하는 것으로 한정한다.
9	8460	24	기타(수치 제어식으로 한정한다)	수치제어방식의 연삭기(grinding machine) 또는 샤프닝 머신(sharpening machine)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
	8460	29	기타	1. 기어 호브 커터(gear hob cutter) 또는 브로치 커터(broach cutter)의 프로파일(profile)이나 날 연삭이 가능한 것
	8460	31	수치제어식	2. 드릴(drill), 엔드밀(end mill) 또는 인서트(insert)의 홈, 여유면, 날끝 각(point) 또는 스플릿 포인트(split point)를 가공하는 전용 연삭기로서, 가공 지름이 0.05밀리미터(mm) 이상 80밀리미터(mm) 이하인 것
	8460	39	기타	3. 제품의 외경을 연삭할 수 있는 설비로서, 센터간 거리가 500밀리미터(mm)이며 주속도는 80미터/초(m/s) 까지 가능한 것

10	8460	40	호닝머신(honing machine)이나 래핑머신(lapping machine)	연마기로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 수분을 포함한 습식 연마제를 사용하여 곡면과 요철 부위를 연마할 수 있고 원심력에 의한 사출 방식인 것 2. 서보모터(servomotor)로 작동하는 상하 구동식 연마기로서 내부지름이 3밀리미터(mm)이상 40밀리미터(mm) 이하인 물체를 연마할 수 있는 것
	8460	90	기타	
11	8462	61	액압식 프레스	주(main) 가압력이 3,250 킬로뉴턴(kN) 이상이고, 6,500 킬로뉴턴(kN) 이하인 것으로 한정한다.
12	8477	51	공기를 넣는 타이어나 성형기나 재생기와 그 밖의 이너튜브(inner tube) 성형기	자동 버핑 머신(auto buffing machine)으로서 타이어나 접지부(tread)의 깊이에 따라 모터를 자동으로 제어하여 접지부 표면을 마모시킬 수 있는 것으로 한정한다.
13	8479	82	혼합기·반죽기·파쇄기·분쇄기·기계식 체·시프팅기(sifting machine)·균질기·유화기·교반기	분쇄기(milling machine)로서 금속(metal), 세라믹(ceramic) 재료를 미분쇄하기 위한 에너지를 얻기 위해 중력가속도(G-force)가 70g 이상인 것으로 한정한다.
14	8479	89	기타	전지용 극판 미세홀 가공기(battery electrode micro hole processing equipment)로서 리튬이온 전지용 전극에 40마이크로미터(μm) 이하의 미세홀을 형성시킬 수 있고 금형과 제어장치를 갖춘 것으로 한정한다.
15	8479	89	기타	5축 분당시스템(dispensing system)으로서 동시에 5축이 움직이면서 스캔을 진행하고 이를 기반으로 분드를 도포할 수 있는 것으로 한정한다.
16	8479	89	기타	알칼리 이온수 생성장치로서 수소이온농도가 13.1피에이치

				(pH) 이상 13.2피에이치(pH) 이하인 알칼리 이온수 80리터(ℓ)를 연속하여 생성하고 내부펌프를 사용하여 외부로 내보낼 수 있는 것으로 한정한다.
17	8479	89	기타	압출기로서 필름 제조 시 스크루(screw)의 회전속도가 0.2알피엠(rpm) 이상 120알피엠(rpm) 이하이며, 속도를 0.1알피엠(rpm) 단위로 조절할 수 있는 것으로 한정한다.
18	8479 8543	89 30	기타 전기도금용·전기분해용·전기영동(泳動)용 기기	코팅기(coating machine), 도금기(plating system)로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 자동차 피스톤 링(piston ring)에 다이아몬드-라이크카본(DLC, Diamond Like Carbon) 또는 4면체비정질탄소(TAC, Tetrahedral Amorphous Carbon)를 코팅할 수 있는 것 2. 로드(rod) 증발원을 탑재하고 아크 스팟(arc spot)의 위치 또는 막 두께의 분포를 자동으로 제어할 수 있는 것 3. 자동차 피스톤 링(piston ring)이 고착(sticking) 되는 현상을 방지하기 위한 코팅을 할 수 있는 것
19	8479	89	기타	자동노치가공기계로서 시료와 노치(notch) 치수에 따라 자동으로 위치를 정하고 절단할 수 있는 것으로 한정한다.
20	8485	10	금속용	3차원프린터(3D printer)로서 14마이크로미터(μm) 이하의 선으로 원하는 회로나 모양을 나타낼 수 있는 것으로 한정한다.
21	8514	19	기타	노(爐, furnace), 오븐, 열처리장치, 열압축가공기, 연속식 소성로 모의 실험장치로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전기로(電氣爐)로서 최고 온도가 300도($^{\circ}\text{C}$) 이상이고 온도의 허용 오차 범위가 ± 8 도($^{\circ}\text{C}$) 이하인 것 2. 열처리장치로서 자동차 피스톤 링(piston ring)의 귀부(tab)에 깊이 30마이크로미터(μm) 이상의 질화층을 형성할 수 있는 것 3. 코터 오븐(coater oven)으로서 이차전지용 양극·음극의 활물질과 첨가제를 가열 및 건조하여 양극재 또는 음극재의 최종 형태로 가공할 수 있는 것
22	8514	19	기타	전기로(電氣爐)로서 0도($^{\circ}\text{C}$) 이상 1600도($^{\circ}\text{C}$) 이하의 온도로 제어할 수 있는 장비로, 유기계 재료를 합성할 수 있고, 신뢰성 평가를 진행할 수 있으며, 유리 용융이 모두 가능한 것으로 한정한다.

23	8515	80	그 밖의 기기	접합부를 압착 또는 마찰하여 용접하는 금속용접기로서 15킬로헤르츠(kHz) 이상 45킬로헤르츠(kHz) 미만의 초음파 복합진동으로 금속을 용접하는 것으로 한정한다.
24	8515	90	부분품	복합 진동 초음파 용접기의 부분품으로서 진동 전달 소재와 홀더(holder)로 구성되어 있어 10킬로헤르츠(kHz) 이상 45킬로헤르츠(kHz) 미만의 진동을 금속 소재에 전달할 수 있는 것으로 한정한다.
25	8543	70	그 밖의 기기	인터페이스 모듈로서 캔(CAN, Controller Area Network), 캔에프디(CANFD, Controller Area Network with Flexible Data rate), 린(LIN, Local Interconnect Network) 또는 플렉스레이(FlexRay) 신호를 유에스비(USB, Universal Serial Bus) 또는 이더넷(Ethernet) 방식을 통해 컴퓨터에 연결할 수 있는 것으로 한정한다.
26	8543	70	그 밖의 기기	신호발생기(DTV signal generator)로서 방송신호를 갈무리(capture)한 기기로부터 기록된 신호를 공유하는 방법으로 신호를 재생할 수 있는 것으로 한정한다.
27	8543	70	그 밖의 기기	무선주파수 신호 증폭기, 고주파 증폭기, 주파수변환기로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 20메가헤르츠(MHz)에서 40기가헤르츠(GHz)까지의 주파수 신호를 무선주파수 케이블 또는 탐침(probe)을 통해 입력받아 증폭시킬 수 있는 것 2. 계측기 규격에 맞게 측정 가능한 영역으로 주파수를 변환할 수 있는 것
28	8543	70	그 밖의 기기	배터리 충전·방전 설비(battery testing system)로서 충전 시 정전류/정전압(CC/CV)과 방전 시 정전류(CC) 방식을 사용하는 이차전지 또는 연료전지의 충전 시험이나 방전시험을 할 수 있는 것으로 한정한다.
29	8543	70	그 밖의 기기	결합 및 감결합 회로망의 양쪽 기능을 통합한 전기 회로 장치로 단말에 인가된 방해신호 외에 다른 노이즈가 단말 전원단에 유입되지 않는 것으로 한정한다.
30	8543	70	그 밖의 기기	양자점 소자 실험을 위한 극저온용 칩 홀더(cryogenic sample holder)로서 저주파용 48채널과 고주파용 16채널을 갖추고, 극저온 호환 및 비자성체 물질로 구성되어 있어 밀리켈빈(mK) 및 고자기장 환경하에서 소자에 양자점을 형성시킬 수 있는 것으로 한정한다.
31	8543	70	그 밖의 기기	양자점 소자 실험을 위한 극저온용 다채널 저주파 통과 필터(compact low pass filter)로서 무선주파수(RF)용

				24채널(cutoff~225MHz)과 저주파(RC)용 24채널(cutoff~65kHz)을 갖추고, 극저온 호환 및 비자성체 물질로 구성되어 밀리켈빈(mK) 및 고자기장 환경하에서 양자점 소자 실험을 위한 신호들에 대한 노이즈를 줄일 수 있는 것으로 한정한다.
32	8543	70	그 밖의 기기	FPGA(Field Programmable Gate Array) 개발 보드로서 컴퓨터와 연결하여 사용자가 로직 게이트(logic gate)의 배치와 연결을 임의 설정하여 로직(logic)을 검증할 수 있는 것으로 한정한다.
33	9029	10	적산(積算) 회전계·생산량계·택시미터·주행거리계·보수계와 이와 유사한 계기	자동차 피스톤 링(piston ring)용 계수기(counter)로서 방향 선별 기능을 가지고 있는 것으로 한정한다.
34	9030	33	기타 (기록장치가 없는 것으로 한정한다)	저항계로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 반도체, 평판디스플레이 또는 이차전지 연구용으로서 웨이퍼박막, 글래스기판박막, 필름 또는 분체(粉體)의 저항을 측정할 수 있는 것 2. 시료에 전자빔을 비춰서 전류를 증폭시키는 비접촉 방식으로 저항을 분석할 수 있는 것
35	9033	00	제90류의 기계·기기·장치·장비용 부분품과 부속품 (이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)	기록장치로서 사용온도가 -10도(℃) 이상 +40도(℃) 이하 범위의 온도를 측정하고 1와트(W) 분해능력으로 소비 전력을 측정할 수 있는 장비를 갖춘 것으로 한정한다.